

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 1 区分
【発行日】令和 6 年 7 月 19 日(2024.7.19)

【公開番号】特開 2023-58299(P2023-58299A)
【公開日】令和 5 年 4 月 25 日(2023.4.25)
【年通号数】公開公報(特許)2023-077
【出願番号】特願 2021-168233(P2021-168233)
【国際特許分類】

H 0 1 J 37/20(2006.01)

10

H 0 1 J 37/28(2006.01)

H 0 1 J 37/147(2006.01)

H 0 1 L 21/66(2006.01)

【F I】

H 0 1 J 37/20 A

H 0 1 J 37/28 B

H 0 1 J 37/147 B

H 0 1 L 21/66 J

【手続補正書】

20

【提出日】令和 6 年 7 月 10 日(2024.7.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に 1 次電子ビームを照射する光学系と、
前記 1 次電子ビームが前記基板に照射されたことに起因して放出される 2 次電子ビーム
を前記 1 次電子ビームから分離するビームセパレータと、
分離された前記 2 次電子ビームを検出する検出器と、
前記基板が載置される、移動可能なステージと、
前記ステージ上で前記基板を支持する支持台と、
前記基板に所定の第 1 電圧を印加する印加部と、
を備え、
前記支持台は、前記基板を下方から支持する複数の支持ピンを有し、
前記支持ピンは、柱状の絶縁体、及び該絶縁体内に設けられた金属膜を含み、
前記金属膜に所定の第 2 電圧が印加されることを特徴とする、電子ビーム検査装置。

30

【請求項 2】

40

前記第 1 電圧と前記第 2 電圧とは同一である、請求項 1 に記載の電子ビーム検査装置。

【請求項 3】

前記金属膜は前記絶縁体に覆われている、請求項 1 又は 2 に記載の電子ビーム検査装置。

【請求項 4】

前記金属膜は、前記支持ピンの高さ方向と直交する方向に配置され、
前記支持ピンの側面と前記金属膜の端部との間隔が 0.3 mm 以上 2 mm 以下である、
請求項 3 に記載の電子ビーム検査装置。

【請求項 5】

前記絶縁体は、上面に凹部が形成された基端体と、下面に凸部が設けられた先端体とを

50

有し、前記凹部と前記凸部とが嵌合されており、

前記凹部の底面と前記凸部の下端面との間に前記金属膜が設けられている、請求項 3 又は 4 に記載の電子ビーム検査装置。

10

20

30

40

50